

©1995 г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОНА-ЗОННОЙ ПОДСВЕТКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ УРОВНЕЙ В МЕТОДЕ ШУМОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

M. E. Левинштейн, С. Л. Румянцев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,
194021, Санкт-Петербург, Россия
(Получена 30 июня 1994 г. Принята к печати 6 июля 1994 г.)

Проанализировано влияние зона-зонной подсветки на генерационно-рекомбинационный шум, обусловленный наличием локального уровня в запрещенной зоне полупроводника.

Показано, что зона-зонная подсветка, создающаяся в объеме полупроводника подвижные неосновные носители, позволяет непосредственно судить о том, зависит ли сечение захвата носителей σ от температуры экспоненциально ($\sigma = \sigma_0 \exp(E_1/kT)$). В случае экспоненциальной зависимости сечения от температуры зона-зонная подсветка позволяет определить параметры уровня даже для случая, когда энергия активации E_1 значительно больше, чем глубина залегания уровня E_0 . В этом случае ($E_1 \gg E_0$) обычные методы обработки данных шумовых измерений позволяют (без использования подсветки) определить только значение E_1 .

Для предельных случаев, когда исследуемый уровень лежит значительно ниже уровня Ферми E_F ($E_0 - E_F \gg kT$) или значительно выше ($E_F - E_0 \gg kT$), предложены простые аналитические выражения, описывающие влияние подсветки на уровень шума. Проделаны численные расчеты, подтверждающие справедливость полученных аналитических выражений.

Метод шумовой спектроскопии локальных уровней широко используется в тех случаях, когда использование наиболее распространенного метода, DLTS, становится затруднительным или невозможным. К таким случаям относится исследование уровней с очень малым сечением захвата $\sigma \leq 10^{-20} \text{ см}^{-2}$, уровней в высокоомных и полуизолирующих полупроводниках, резонансных уровней в разрешенных зонах (см., например, [1-6]).

Весьма часто сечение захвата уровней, идентифицируемых методом шумовой спектроскопии, экспоненциально зависит от температуры: $\sigma = \sigma_0 \exp(E_1/kT)$ [1,2,4,6,7]. В таких условиях обработка экспериментальных результатов стандартным способом, с помощью построения прямых Аррениуса, приводит к грубым ошибкам в определении глубины залегания уровня E_0 , а иногда и к качественно неверным результатам (см. соответствующий анализ в работе [8]).

Недавно в работе [8] был предложен новый метод определения параметров уровней из результатов шумовых измерений, позволяющий в условиях экспоненциальной зависимости сечения захвата от температуры определять все основные параметры локального уровня: глубину залегания E_0 , энергию E_1 , сечение σ_0 и концентрацию примесных центров N_t .

Предложенный в работе [8] метод состоит в следующем.

Рассматривается типичная экспериментальная ситуация. Полупроводник (для определенности n -типа проводимости) легирован мелкой примесью с концентрацией N_d , значительно превосходящей концентрацию всех других уровней. Во всем рассматриваемом температурном диапазоне мелкие доноры полностью ионизованы ($n_0 = N_d$). Положение уровня Ферми E_F в запрещенной зоне определяется выражением

$$E_F = kT \cdot \ln \frac{N_c}{N_d}, \quad (1)$$

где N_c — эффективная плотность состояний в зоне проводимости. В запрещенной зоне полупроводника существует локальный уровень с глубиной залегания E_0 и концентрацией N_t . Флуктуации заселенности этого уровня определяют наблюдаемые флуктуации сопротивления.

Пусть результаты измерений представлены в виде зависимости относительной спектральной плотности шума от температуры $S(T)$ для нескольких частот анализа (рис. 1). Такая форма представления результатов достаточно типична [4,7,9–11].

В одном из двух рассмотренных в работе [8] предельных случаев, когда уровень Ферми в температурном диапазоне измерений лежит ниже уровня E_0 ($E_F \gg E_0$, уровень практически пуст), выражение для спектральной плотности шума S имеет вид [8]

$$S = \frac{S_R}{R^2} = \frac{S_I}{I^2} \cong A\tau_0^2 \frac{F^2 e^{(E_1/kT)}}{1 + \omega_0^2 \tau_0^2 F^2 e^{(2E_1/kT)}}, \quad (2)$$

где $A = 4N_t/VN_d^2$, V — объем образца, $\omega = 2\pi f$ — круговая частота, f — частота анализа, $\tau_0 = (\sigma_0 v_t n_0)^{-1}$, v_t — тепловая скорость электро-

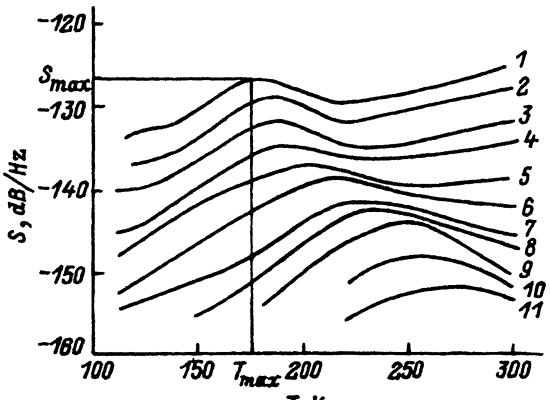


Рис. 1. Температурная зависимость спектральной плотности шума для GaAs с концентрацией мелких доноров $N_d = 10^{15} \text{ см}^{-3}$ [4]. Частота анализа $f = \omega/2\pi$, Гц: 1 — 20, 2 — 40, 3 — 80, 4 — 160, 5 — 320, 6 — 640, 7 — 1280, 8 — 2500, 9 — $5 \cdot 10^3$, 10 — 10^4 , 11 — $2 \cdot 10^4$.

нов, F — функция заполнения уровня,

$$F = \frac{1}{1 + e^{[(E_F - E_0)/kT]}}. \quad (3)$$

Предполагается, что энергия отсчитывается от дна зоны проводимости вниз к валентной зоне.

В рассматриваемом случае ($E_F \gg E_0$)

$$F \cong \frac{N_d}{N_c} e^{E_0/kT} \ll 1. \quad (4)$$

Как показано в работе [8], температура T_{\max} для частоты анализа $\omega = 2\pi f$ (см. рис. 1) может быть определена из условия

$$\frac{1}{kT_{\max}} = \frac{1}{2(E_0 + E_1)} \ln \frac{2E_0 + E_1}{E_1 \omega^2 \tau_0^2 (N_d/N_c)^2}. \quad (5)$$

Из выражения (5) следует, что при $E_1 \gg E_0$ для каждой частоты наблюдения ω условию $T = T_{\max}$ соответствует равенство $\omega\tau = 1$, где $\tau = \tau_0 F \exp(E_1/kT_{\max})$ — постоянная времени релаксации уровня при отклонении заполнения от равновесного значения. Интересно отметить, что во многих работах, где при анализе экспериментальных результатов температурной зависимостью сечения захвата пренебрегается (т.е. предполагается, что $E_1 = 0$), также принимается, что $\omega\tau = 1$ при $T = T_{\max}$ (см., например, [7, 9]). Между тем при $E_1 = 0$ такое предположение неверно и может приводить к существенной погрешности при определении глубины залегания уровня E_0 (см. *Приложение*).

Используя (5), из выражения (2) легко найти значение S_{\max} в максимуме на частоте ω при температуре T_{\max} :

$$S_{\max} = \frac{A}{\tau_0} \frac{\tau_1^2 \left(\frac{2E_0 + E_1}{\omega^2 \tau_1^2 E_1} \right)^{(2E_0 + E_1)/(2E_0 + 2E_1)}}{1 + \frac{2E_0 + E_1}{E_1}}, \quad (6)$$

где $\tau_1 = \tau_0(N_d/N_c)$.

Из выражения (5) следует, что зависимость $1/kT_{\max}$ от $\ln \omega$ представляет собой в рассматриваемом случае прямую линию, тангенс угла наклона которой к оси абсцисс равен $1/(E_1 + E_0)$. Из выражения (6) видно, что наклон прямой зависимости $\ln S_{\max}$ от $\ln \omega$ равняется $(2E_0 + E_1)/(E_0 + E_1)$. Таким образом, построив для нескольких частот анализа зависимости $1/kT_{\max}$ от $\ln \omega$ и $\ln S_{\max}$ от $\ln \omega$, можно определить раздельно энергию активации E_1 и глубину залегания уровня E_0 . Затем из выражений, приведенных в [8], определяются значения σ_0 и N_t .

Заметим, что в рассматриваемом предельном случае наклон зависимости $\ln S_{\max}$ от $\ln \omega$ лежит в пределах от 1 до 2 в зависимости от соотношения E_1 и E_0 . При $E_1 \ll E_0$ зависимость S_{\max} от ω близка к виду $S_{\max} \propto 1/\omega^2$. При $E_1 \gg E_0$ $S_{\max} \propto 1/\omega$. В последнем случае и зависимость $1/kT_{\max}$, и зависимость $\ln S_{\max}$ от $\ln \omega$ определяются практически только величиной E_1 . В этом случае величина E_0 предложенным методом определена быть не может.

В противоположном предельном случае, когда уровень Ферми во всем температурном диапазоне измерений лежит выше уровня E_0 ($E_F \ll E_0$, уровень практически заполнен), выражение для S имеет вид

$$S \simeq A\tau_0 \frac{e^{E_1/kT}(1-F)}{1+\omega^2\tau_0^2 e^{2E_1/kT}}. \quad (7)$$

Температура T_{\max} определяется выражением

$$\frac{1}{kT_{\max}} = \frac{1}{2E_1} \ln \frac{(E_1 - E_0)}{(E_1 + E_0)\omega^2\tau_0^2}. \quad (8)$$

Величина S_{\max} при температуре T_{\max} равняется

$$S_{\max} = \frac{A\tau_0 \frac{N_c}{N_d} \left(\frac{E_1 - E_0}{(E_1 + E_0)\omega^2\tau_0^2} \right)^{(E_1 - E_0)/2E_1}}{1 + \frac{E_1 - E_0}{E_1 + E_0}}. \quad (9)$$

При $E_1 < E_0$ в этом случае максимум на зависимости $S(T)$ отсутствует. При $E_1 > E_0$ наклон зависимости $1/kT_{\max}$ от $\ln \omega$ определяется величиной E_1 , наклон зависимости $\ln S_{\max}$ от $\ln \omega$ — величиной $(E_1 - E_0)/E_1$ [8]. Очевидно, что при $E_1 \gg E_0$ в этом, как и в предыдущем, случае $S_{\max} \propto 1/\omega$. При уменьшении отношения E_1/E_0 наклон зависимости $S_{\max}(\omega)$ уменьшается, стремясь к нулю при E_1/E_0 , стремящемсяся к единице.

Как показывает проделанный в [8] анализ многочисленных экспериментальных данных, случай, когда $E_1 \gg E_0$, реализуется экспериментально достаточно часто. В этом случае предложенная в [8] методика не позволяет определить глубину залегания уровня E_0 . Более того, из приведенных выше результатов ясно, что в этом случае из данных шумовой спектроскопии трудно даже судить, выше или ниже уровня Ферми находится исследуемый уровень.

Покажем, что использование зона-зонной подсветки может позволить уточнить глубину залегания уровня E_0 .

Ранее слабая зона-зоная подсветка ($\Delta\sigma \ll \sigma_0$, где $\Delta\sigma$ — фотопроводимость при подсветке, σ_0 — темновая проводимость) была использована в ряде работ для определения природы шума $1/f$ в Si и GaAs (см. соответствующие ссылки в работе [12]). Было показано, что возникающие при межзонной подсветке неосновные носители (дырки), захватывающиеся на уровни, ответственные за низкочастотный шум в полупроводниках, способны сильно изменить функцию заполнения уровней F даже при $\Delta\sigma/\sigma \leq 10^{-3} \div 10^{-5}$. Изменение F влечет за собой изменение уровня шума.

Как показано в работе [13], в присутствии подсветки при концентрации свободных дырок p выражение для спектральной плотности шума сохраняется при замене F на F^* , где

$$F^* = \frac{1}{1 + \beta F} = \frac{1}{1 + \beta + e^{(E_F' - E_0)/kT}}, \quad (10)$$

$\beta = \tau_0/\tau_p$, $\tau_p = (\eta p)^{-1}$, η — вероятность захвата дырки на рассматриваемый уровень в единицу времени в единице объема.

Параметр β , пропорциональный концентрации свободных дырок p , при малых уровнях подсветки ($\Delta n \ll n_0$) пропорционален, очевидно, интенсивности освещения J . Заметим, что концентрация подвижных дырок p определяется не только захватом на данный уровень, но и захватом на все рекомбинационные уровни в материале. Заметим также, что концентрация подвижных дырок может быть значительно меньшей, чем концентрация избыточных электронов Δn , определяющая фотопроводимость (см., например, [14, 15]).

Снова вернемся к случаю, когда уровень Ферми лежит ниже исследуемого уровня (уровень практически пуст). Пусть из темновых измерений определена температура T_{\max} и амплитуда шума S_{\max} на данной частоте ω . При температуре T_{\max} осуществим слабую зона-зонную подсветку образца. Изменение шума будет определяться величиной и знаком производной $dS_{\max}/d\beta$. Заменяя в выражении (2) F на F^* и используя (5), получим

$$\frac{dS_{\max}}{d\beta} = -\frac{A\tau_0}{2} \left(\frac{N_d}{N_c} \right)^3 e^{(3E_0+E_1)/kT_{\max}}. \quad (11)$$

Шум уменьшается с увеличением интенсивности подсветки.

На рис. 2 и 3 показаны результаты численных расчетов влияния зона-зонной подсветки на шумовые спектры уровня, экспериментально наблюдавшегося в работе [4]. Уровень, обусловленный, по-видимому, структурными дефектами, наблюдался в работе [4] в n -GaAs с концентрацией электронов $n_0 = 10^{15} \text{ см}^{-3}$ в диапазоне температур 170–250 К (рис. 1). Уровень характеризуется глубиной залегания $E_0 \cong 0.1 \text{ эВ}$, экспоненциальной температурной зависимостью сечения захвата σ и очень малым ($\sigma = 10^{-19} \div 10^{-21} \text{ см}^2$) значением сечения в исследованном температурном диапазоне.

При расчете использовались экспериментальные данные для объема образца $V = 5 \cdot 10^{-8} \text{ см}^3$, концентрации доноров $N_d = 10^{15} \text{ см}^{-3}$, глубины залегания уровня $E_0 = 0.1 \text{ эВ}$. Величины $E_1 = 0.25 \text{ эВ}$, $N_t = 5 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$ и $\sigma_0 = 5 \cdot 10^{-14} \text{ см}^2$ определены из экспериментальных данных по методике, описанной в [8]. Расчет проделан с учетом температурной зависимости тепловой скорости электронов v_t ($v_t \propto T^{1/2}$) и плотности состояний N_c ($N_c \propto T^{3/2}$) по общей формуле для спектральной плотности шума. Значение N_c принималось равным $N_c [\text{см}^{-3}] = 3.9 \cdot 10^{17} (T [\text{К}] / 300)^{3/2}$, величина тепловой скорости — $v_t [\text{см}/\text{с}] = 4.6 \cdot 10^7 (T [\text{К}] / 300)^{1/2}$. В GaAs с $n_0 = 10^{15} \text{ см}^{-3}$ уровень Ферми лежит ниже исследуемого уровня ($E_F > 0.1 \text{ эВ}$) при температурах $T \geq 200 \text{ К}$.

На вставке к рис. 2 показаны температурные зависимости $S(T)$ в районе температур максимума T_{\max} для четырех частот анализа. Видно, что подсветка при $T = T_{\max}$ подавляет шум. С ростом частоты анализа (повышением T_{\max}) влияние подсветки на шум уменьшается.

На рис. 2 показаны зависимости S_{\max} от β для различных частот анализа. Видно, что при малых β уменьшение амплитуды шума с возрастанием β (увеличением интенсивности подсветки) остается линейным при достаточно больших изменениях S , которые легко могут быть

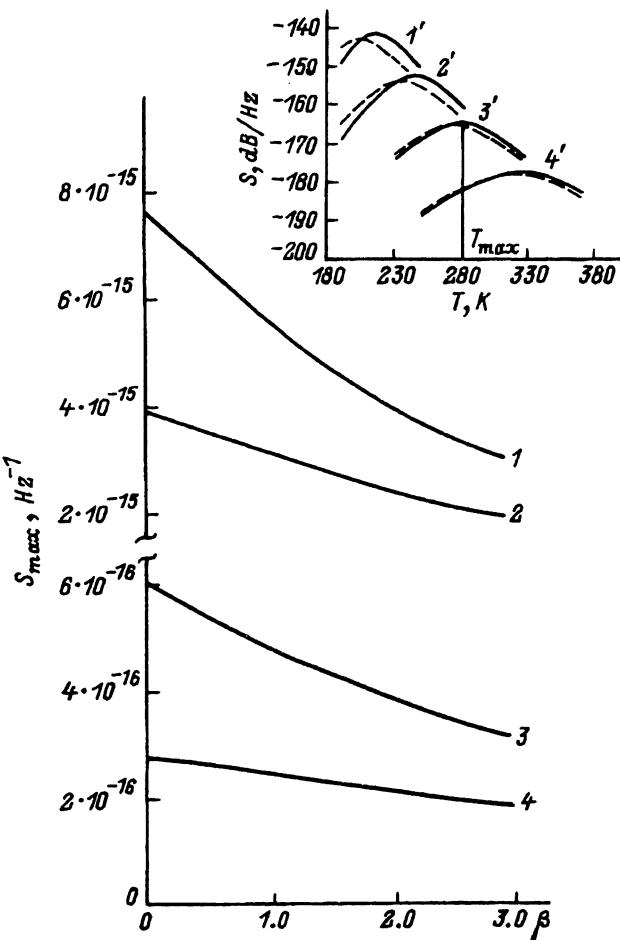


Рис. 2. Зависимость шума при температурах T_{\max} от β для различных частот анализа. Следует обратить внимание на разрыв в шкале по вертикальной оси и линейную шкалу для значений S .

Частоты анализа $f = \omega/2\pi$, Гц: 1 — 10^3 , 2 — $2 \cdot 10^3$, 3 — 10^4 , 4 — $2 \cdot 10^4$. На вставке — расчетные температурные зависимости $S(T)$ для различных частот анализа (ср. с экспериментальными зависимостями на рис. 1), сплошные линии — темновые зависимости, штриховые — расчет для $\beta = 3$, частота анализа $f = \omega/2\pi$, Гц: 1' — 10^3 , 2' — 10^4 , 3' — 10^5 , 4' — 10^6 .

измерены экспериментально. С дальнейшим увеличением β зависимость $S(\beta)$ заметно насыщается.

Из выражения (11) следует, что если измерить значение $\gamma = dS_{\max}/d\beta$ для нескольких частот анализа $\omega = 2\pi f$ (т.е. для нескольких значений температуры T_{\max}), а затем построить зависимость $\ln \gamma$ от $1/T_{\max}$, то наклон прямой зависимости $\ln \gamma$ от $1/T_{\max}$ определится величиной $3E_0 + E_1$ (рис. 3). На рис. 3 показана зависимость $\ln \gamma$ от $1/T_{\max}$, рассчитанная для того же центра в GaAs, параметры которого анализировались выше. Видно, что при $1000/T_{\max} \leq 4$ ($T_{\max} \geq 250$ К) зависимость $\ln \gamma$ от $1/T_{\max}$ действительно близка к прямой. Определив

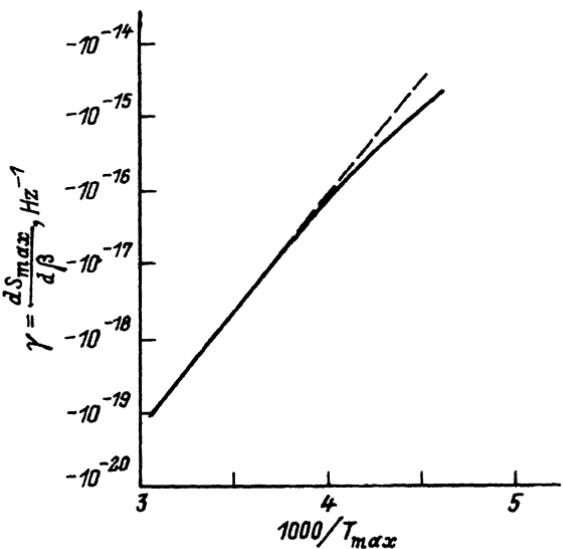


Рис. 3. Зависимость $\gamma = (dS_{\max}/d\beta)$ от $1000/T_{\max}$ (сплошная линия). Штриховая прямая соответствует тангенсу угла наклона к оси абсцисс, равному $3E_0 + E_1$.

значение $\tan \theta \simeq 3E_0 + E_1$ и зная величину E_1 из темновых измерений, можно найти глубину залегания уровня E_0 . Заметим, что с практической точки зрения наличие множителя 3 перед E_0 весьма важно. Как показывает опыт численных расчетов и анализа экспериментальных данных [8], при $E_0 \leq 0.1E_1$ наклон темновой зависимости $\ln S_{\max}$ от $\ln \omega$, определяемый величиной $(2E_0 + E_1)/(E_0 + E_1) \leq 1.1$ (см. выражение (6)), при практически достижимой экспериментальной точности невозможно отличить от единицы. Однако наклон, соответствующий $\tan \theta \simeq 1.3E_1$, легко отличить от наклона, соответствующего величине $\tan \theta \simeq E_1$.

Важно заметить также, что для определения величины E_0 указанным способом не нужно определять абсолютные значения β . Считая, что при малых β величина β пропорциональна интенсивности подсветки J , достаточно измерить значения dS_{\max}/dJ при нескольких частотах анализа и построить зависимость $\ln(dS_{\max}/dJ)$ от $1/T_{\max}$. Из выражения (11) ясно, что наклон этой зависимости также равен $3E_0 + E_1$.

Рассмотрим теперь противоположный предельный случай, когда уровень Ферми лежит выше исследуемого уровня (уровень практически заполнен). Из выражения (9) с учетом (10) можно найти величину $\gamma = dS_{\max}/d\beta$:

$$\gamma = \frac{dS_{\max}}{d\beta} = A\tau_0 \frac{E_1 + E_0}{2E_1} e^{E_1/kT_{\max}}. \quad (12)$$

Видно, что в этом случае величина $dS_{\max}/d\beta$ положительна. С ростом температуры величина γ убывает.

На рис. 4 показаны зависимости $S_{\max}(\beta)$, численно рассчитанные для уровня, наблюдавшегося в сильно легированном ($N_d \cong 10^{17} \text{ см}^{-3}$) n -GaAs в работе [16]. При расчете использовались экспериментальные данные для объема образца $V = 2 \cdot 10^{-9} \text{ см}^3$ и концентрации доноров $N_d = 10^{17} \text{ см}^{-3}$, а также параметры уровня, установленные в работе [8]: глубина залегания $E_0 = 0.07 \text{ эВ}$, энергия активации сечения захвата

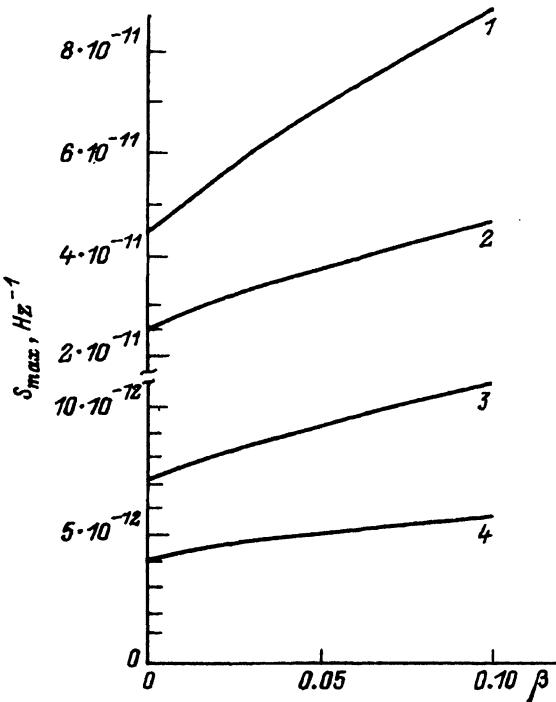
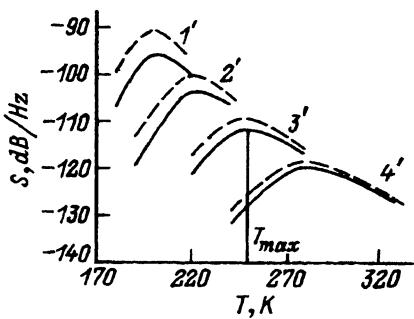


Рис. 4. Зависимости шума при температурах T_{\max} от β для частот анализа $f = \omega/2\pi$, Гц: 1 — 0.1, 2 — 0.2, 3 — 1, 4 — 2. На вставке — расчетные температурные зависимости $S(T)$ для частот анализа $f = \omega/2\pi$, Гц: 1' — 10^{-2} , 2' — 10^{-1} , 3' — 1, 4' — 10.

Сплошные линии — темновые зависимости, штриховые — расчет для $\beta = 0.1$.

$E_F = 0.4$ эВ, $N_t = 5 \cdot 10^{15}$ см $^{-3}$ и $\sigma_0 = 2 \cdot 10^{-16}$ см 2 . При $T < 300$ К уровень лежит заметно ниже уровня Ферми и коэффициент заполнения F близок к единице. На вставке к рис. 4 показаны температурные зависимости $S(T)$ в районе температур максимума T_{\max} для четырех частот анализа при одном и том же значении $\beta = 0.1$. Подсветка увеличивает шум. С ростом частоты анализа (с повышением T_{\max}) влияние подсветки на шум уменьшается). Из рис. 4 видно, что при малых β шум растет линейно с β (с увеличением интенсивности подсветки) так, что величина $dS_{\max}/d\beta$ может быть измерена экспериментально. Видно, что линейному росту $S_{\max}(\beta)$ соответствуют гораздо меньшие, чем в противоположном предельном случае, величины β (ср. с рис. 2).

На рис. 5 показана зависимость $\ln \gamma = \ln(dS_{\max}/d\beta)$ от $1/T_{\max}$, рассчитанная для анализируемого уровня. Видно, что при $T_{\max} < 250$ К

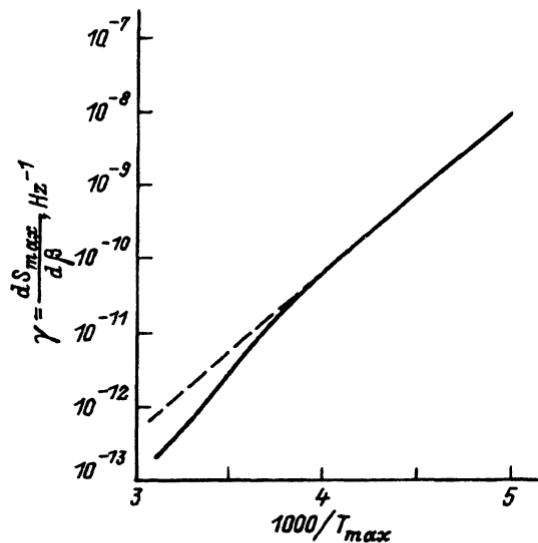


Рис. 5. Зависимость $\gamma = (dS_{\max}/d\beta)$ от $1000/T_{\max}$ (сплошная линия). Штриховая прямая соответствует тангенсу угла наклона к оси абсцисс, равному E_1 .

зависимость представляет собой прямую линию. Легко проверить, что наклон прямой к оси абсцисс соответствует величине $E_1 = 0.4 \text{ эВ}$.

Таким образом, для обоих предельных случаев аналитические выражения (11) и (12) хорошо совпадают с результатами точных численных расчетов, проделанных по полной формуле для зависимости $S(\omega, T)$ с учетом температурной зависимости v_t и N_c .

Использование зона-зонной подсветки может оказаться полезным также при определении глубины залегания уровня E_0 в случае, когда в использованном температурном диапазоне уровень Ферми пересекает исследуемый уровень.

Для этого случая в работе [1] предложен метод определения величины E_0 . Однако этот метод может быть использован только при соблюдении двух условий. Результаты шумовых измерений должны быть представлены в форме частотных зависимостей $S(\omega)$ при различных температурах. Зависимость постоянной времени τ от температуры должна быть измерена в достаточно широком диапазоне температур. К сожалению, выполнить второе условие удается достаточно редко. Наблюдениям в широком температурном диапазоне мешают другие источники шума.

Между тем, когда результаты представлены в форме зависимостей $S(T)$ при различных частотах анализа (рис. 1), характерные максимумы на зависимостях $S(T)$ удается наблюдать даже тогда, когда проследить за зависимостью $\tau(T)$ в сколько-нибудь широком диапазоне температур на кривых $S(\omega)$ не удается [7,8].

Ранее мы видели, что если при температуре T_{\max} на частоте ω уровень лежит заметно ниже уровня Ферми ($E_F \ll E_0$), зона-зонная подсветка повышает шум при температуре T_{\max} . При $E_F \gg E_0$ подсветка понижает шум. Покажем, что если на частоте анализа ω_0 при температуре максимума $T_{0\max}$ подсветка не влияет на шум ($dS_{\max}/d\beta = 0$), то при температуре $T_{0\max}$ уровень Ферми совпадает с исследуемым уровнем E_0 (для случая $E_1 \gg E_0$).

Для этого прежде всего заметим, что при $E_1 \gg E_0$ условие максимума на зависимости $S(T)$ во всех случаях имеет вид

$$\omega\tau = 2\pi f\tau_0 F e^{(E_1/kT)} = 1.$$

В самом деле, с учетом температурной зависимости сечения захвата полное выражение для спектральной плотности шума имеет вид

$$S = A\tau_0 \frac{e^{E_1/kT} F^2 (1 - F)}{1 + (\omega\tau_0 F e^{E_1/kT})^2}. \quad (13)$$

При $E_1 \gg E_0$ температурная зависимость S определяется в основном изменением с температурой сечения захвата. Следовательно, величину F можно приближенно считать не зависящей от температуры. При этом, дифференцируя S по $1/kT$, получим, что условию максимума соответствует равенство

$$\omega\tau_0 F e^{E_1/kT_{\max}} = aF = 1. \quad (14)$$

С другой стороны, записав условие $\gamma = dS_{\max}/d\beta = 0$ в виде $\gamma = (dS/dF) \cdot (dF/d\beta)$, легко убедиться, что величина γ может равняться нулю только при $dS/dF = 0$. Дифференцируя (13) по F , получим, что $dS/dF = 0$ при

$$2 - 3F - a^2 F^3 = 0, \quad (15)$$

или, с учетом (14), $F = 0.5$. Условие $F = 0.5$ означает, что уровень Ферми совпадает с исследуемым уровнем.

Таким образом, изменение знака $dS_{\max}/d\beta$ при температуре максимума $T_{0\ max}$ соответствует пересечению уровнем Ферми исследуемого уровня.

Интересно отметить, что в случае, когда $E_0 \gg E_1$, т.е. когда сечение захвата можно считать не зависящим от температуры, слабая подсветка не должна влиять на уровень шума в максимуме S_{\max} ни при каких частотах анализа. В самом деле, при $E_1 = 0$ от температуры зависит только функция заполнения F :

$$S = A\tau_0 \frac{F^2 (1 - F)}{1 + (\omega\tau_0 F)^2}. \quad (16)$$

Очевидно, что условие максимума на температурной зависимости шума $dS/dF = 0$ совпадает с условием $dS/d\beta = 0$.

Таким образом, использование зона-зонной подсветки позволяет достаточно просто установить, зависит ли экспоненциально сечение захвата исследуемого уровня от температуры. Отсутствие зависимости шума при $S = S_{\max}$ от слабой подсветки при всех частотах анализа служит доказательством того, что сечение не зависит или слабо зависит от температуры.

Авторы искренне признательны Н.В. Дьяконовой и М.И. Дьяконову за прочтение рукописи и ценные замечания. Мы также искренне признательны за финансовую поддержку настоящей работы Cree Research Inc.

Покажем, что при отсутствии экспоненциальной зависимости сечения захвата уровня от температуры ($E_1 = 0$) условию максимума на температурной зависимости $S(T)$ может отвечать, в принципе, сколь угодно большое значение $\omega\tau$. Дифференцируя (16) по F , получим, что максимум на зависимости $S(T)$ отвечает условию

$$2 - 3F - b^2 F^3 = 0, \quad (17)$$

где $b = \omega\tau_0$.

При $b \ll 1$ решение (17) $F = 2/3$ соответствует хорошо известному условиям максимума в области низких частот анализа $\omega\tau = \omega\tau_0 F \ll 1$. При $b \gg 1$ решению (17) отвечает условие

$$F = \sqrt[3]{2/b^2}$$

или

$$\omega\tau = \omega\tau_0 F = \sqrt[3]{2b}. \quad (18)$$

Как правило, при шумовой спектроскопии локальных уровней частотный диапазон анализа составляет 4–6 порядков. Если предположить, что на нижних частотах анализа ω максимуму на зависимости $S(T)$ отвечает условие $\omega\tau \simeq 1$, то на верхних частотах значению S_{\max} будет отвечать условие $\omega\tau \simeq 30–120$.

Обычно при построении прямых Аррениуса для определения величины E_0 стараются уменьшить погрешность, откладывая по оси абсцисс не величину $\tau = 1/\omega = 1/2\pi f$, а величину $T^2\tau$. Таким образом учитывается температурная зависимость тепловой скорости носителей v_t и плотности состояний N_c . При этом, однако, принимается, что при $T = T_{\max}$ на всех частотах выполняется условие $\omega\tau = 1$. При изменении частоты анализа на 4–6 порядков температура максимума T_{\max} редко меняется больше чем в 2 раза. Таким образом, погрешность из-за неучета температурной зависимости N_c и v_t практически не превышает 4%. В то же время погрешность из-за пренебрежения зависимостью величины $\omega\tau$ от ω (при $T = T_{\max}$), как видно из приведенной оценки, может приводить к ошибке на 1.5–2 порядка.

Список литературы

- [1] J.A. Copeland. IEEE Trans. Electron. Dev., **ED-18**, 50 (1971).
- [2] J. Magarshack, A. Mircea, A. Roussel. Acta Electron., **15**, 233 (1972).
- [3] З.Л. Шоблицкис, В.П. Паленскис. Лит. физ. сб., **35**, 88 (1985).
- [4] Н.В. Дьяконова, М.Е. Левинштейн, С.Л. Румянцев. ФТП, **25**, 355 (1991).
- [5] Н.Б. Лукьянчикова. Лит. физ. сб., **20**, 25 (1980).
- [6] J.R. Kirtley, T.N. Theis, P.M. Mooney, S.L. Wright. J. Appl. Phys., **63**, 1541 (1986).
- [7] D. Sodini, A. Touboul, G. Lecoy, M. Savelli. Electron. Lett., **12**, 42 (1976).
- [8] M.E. Levinshstein, S.L. Rumyantsev. Semicond. Sci. Techn. (1994) (в печати).
- [9] F.J. Scholz, J.W.-Roach. Sol. St. Electron., **35**, 447 (1992).
- [10] K. Kandiah. Proc. 8th Int. Conf. on «Noise in Phys. Syst» and 4th Int. Conf. on «1/f Noise» (Rome, 1985) p. 19.
- [11] D.C. Murray, A.G.R. Evans, J.C. Curter. IEEE Trans. Electron Dev., **ED-38**, 407 (1991).
- [12] Н.В. Дьяконова, М.Е. Левинштейн, С.Л. Румянцев. ФТП, **25**, 2065 (1991).

- [13] Н.В. Дьяконова, М.Е. Левинштейн. ФТП, **23**, 283 (1989).
- [14] В.М. Ботнарюк, Ю.В. Жиляев, А.Г. Кечек, Н.И. Кузнецов, А.А. Лебедев, М.И. Шульга. Письма в ЖТФ, **14**, 181 (1988).
- [15] G.A. Acket, J.J. Scheer. Sol. St. Electron., **14**, 167 (1971).
- [16] М.Е. Левинштейн, С.Л. Румянцев. Письма в ЖТФ, **19**, 55 (1993).

Редактор Л.В. Шаронова

The use of the band-to-band illumination to determine local level parameters in the noise spectroscopy technique

M.E. Levinstein, S.L. Rumyantsev

A.F. Ioffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, 194021 St. Petersburg, Russia

The effect of the band-to-band illumination on the generation-recombination noise has been analyzed. It is shown that this illumination makes it possible to determine directly the local level parameters if the capture cross-section of carriers σ depends exponentially on the temperature ($\sigma = \sigma_0 \exp(E_1/kT)$). For the case when the capture cross-section depends on the temperature exponentially, this technique allows to find the parameters of local levels, $E_1 \gg E_0$ (E_0 being the level position in the forbidden gap). In the limiting cases, when Fermi level E_F lies significantly below ($(E_F - E_0) \gg kT$) or above ($(E_F - E_0) \ll kT$) in relation to E_0 level, simple analytical expressions have been obtained. Computer simulations agree well with the analytical expressions obtained.
